



教授 赤津隆

片柳研究所 CMCセンター

メンバー

片柳研究所
教授
赤津隆

片柳研究所
特別研究教授
田中義久

片柳研究所
特別研究教授
武田道夫

片柳研究所
特別研究教授
藤原力

片柳研究所
特別研究教授
曾我部智浩

片柳研究所
客員教授
平田一郎

片柳研究所
助教
関川貴洋

材料の計測評価設備

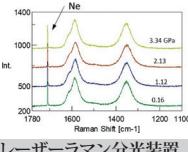
9 研究と技術革新の
ための新技術11 日本をけんかう
する研究者たち

KEYWORDS 分析評価、計測技術、応力分布、高温計測技術、破損原因解析、フラクトグラフィ

当センターでは、CMCの実用化に向けた課題解決に幅広い取組みを推進しています。CMCで培った技術により、材料中に存在する不均一応力、残留応力などの計測法、力や熱が作用した場合のその場ひずみ計測法の技術開発を行っています。企業や大学の研究者・技術者に対する、学問的・技術的課題の解決と発展への貢献を目指しています。

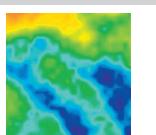
応力およびひずみ分布計測

01 微視応力分布



顕微レーザーラマン分光法を用いて、纖維やマトリックスの結晶構造の解析やピーク波数が応力に対してシフトする現象を利用した複合材料中の纖維の熱応力、残留応力や不均一応力分布の計測を行っています。

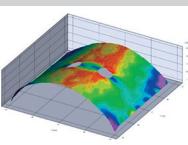
02 高温ひずみ分布計測



高温ひずみ計測装置

紫外光照明を用いて、室温から1400°Cまでの温度域で材料に負荷を与えるながらその場で観察できる装置です。この装置を用いて不均一構造の熱ひずみ分布や損傷過程のその場観察を行うことができます。

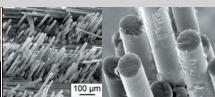
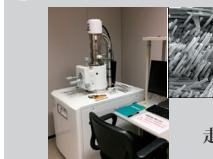
03 3次元ひずみ分布



3次元ひずみ計測装置

2台のデジタルカメラを用いて、材料や部品の全視野の変形計測やひずみ解析を非接触・3次元で測定する装置です。複合材料の不均一変形・ひずみ分布の解析を行っています。

04 走査型電子顕微鏡



走査型電子顕微鏡

纖維の破壊形態や複合材料の損傷メカニズムを調べるために使用しています。フラクトグラフィの解析も行なっています。

想定される活用例、相談可能な分野

- 複合材料、電子材料、高分子材料、バイオマス材料など、さまざまな材料の力学特性評価、非破壊評価を行うことができます。
- 複数の試験方法により、多面的に材料を評価することができます。